研究单原子分子表面扩散运动的 时域隧穿电流谱方法*

王克东 张春 雷明德 肖旭东[†]

(香港科技大学物理系 香港)

摘 要 以单个 Cu 原子在 S(111)(7×7)层错半单元(F-HUC)内的随机扩散运动研究为例,演示了一种新的 可以测量快速扩散运动的扫描隧道显微镜方法——时域隧穿电流谱方法.运用这种方法可定量地检测纳米局域区 间内单原子分子的表面扩散运动,跳跃频率的测量范围达到1—10⁴Hz,比过去已有的用扫描隧道显微镜研究表面 扩散的方法提高三个量级.这种方法将会使人们在原子尺度下对快速扩散运动比如氢原子的量子扩散运动获得更 进一步的理解.

关键词 半导体表面 表面热力学 扩散 扫描隧道显微镜

Time-dependent tunneling spectroscopy for studying surface diffusion of single particles confined in nanostructures

WANG Ke-Dong ZHANG Chun LEI Ming-De XIAO Xu-Dong[†] (Department of Physics, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong, China)

Abstract By confining a diffusion atom in a nanometer region using surface potential heterogeneity we have successfully employed time-dependent tunneling spectroscopy to study its random motion quantitatively. A hopping rate in the range of $1-10^4$ Hz, approximately 3 orders of magnitude faster than those accessible by existing diffusion methods based on scanning tunneling microscopy, was demonstrated for single Cu atoms diffusing in the faulted half – unit cell of Si(111)-7 × 7. Our technique is potentially useful for detecting fast diffusion processes such as hydrogen quantum diffusion on the atomic scale.

Keywords semiconductor surfaces , surface thermodynamics , diffusion , scanning tunneling microscopy

表面扩散在物理、化学、生物和材料科学中都是 一个很重要的研究课题,它在化学反应尤其是表面 催化反应、分子自组装、晶体生长和薄膜外延生长等 过程中都起着关键性作用,因而引起了很多科研工 作者的兴趣^[1].对扩散系数等描述扩散运动的参数 测量很大程度上依赖于测试技术的发展.在各种测 试技术中,扫描隧道显微镜作为一种无损表面的探 测工具,由于其可以同时得到原子分辨率的表面结 构与扩散粒子的吸附位置和轨迹等信息^[2],因而在 原子尺度下观察扩散粒子的运动有其独特的优势. 但由于受限于电子反馈系统,常用的连续扫描图 像^[3]和原子跟踪方法^[4]只能探测比较慢速的扩散 运动.例如在原子跟踪方法中不需要扫描完整的图 像,最快的可测量的跳跃频率也只是大约10Hz^[3] (相当于扩散系数10⁻¹⁴ cm²/s).即使 Besenbacher, Renisch 等使用特制的STM,也只能获得约10幅图 像/秒的扫描速度^[5,6].所以,用连续扫描图像的方 法也只能探测10Hz 的跳跃频率.这一点大大限制 了STM 在研究较快速表面扩散问题方面的应用.例 如,Gomer^[7]和他的合作者研究发现在很多系统中 氢原子量子扩散的扩散系数都在10⁻¹³到10⁻¹⁰ cm²/s 范围,已超过了现有扫描隧道显微镜方法的探测能

† 通讯联系人. Email : phxudong@ ust. hk

 ^{*} 香港 William Mong Solid State Clusters Laboratory Research Grants Council of Hong Kong 资助项目
2005 - 04 - 25 收到

力. 由于量子扩散运动不会随温度降低而变慢,因此 在低温下使用 STM 测量仍未能解决问题.

在这里,我们通过一个实例来展示一种新的利 用扫描隧道显微镜测量快速表面扩散运动的方 法^[8].这种方法可以使跳跃频率的测量比常用的连 续扫描图像^[3]和原子跟踪方法^[4]至少提高三个量 级,达到约10⁴Hz(相当于扩散系数为10⁻¹¹cm²/s). 如果使用更快速的前置放大器和数据采集系统,可 测的扩散速度的范围可以获得进一步的拓展.这种 扩展不仅使 STM 可以直接测量快速扩散运动,而且 使它用来研究氢原子量子扩散运动成为可能.

图1显示这种新方法的原理图.在这个模式下, STM 针尖固定在表面上某一感兴趣的吸附位置上 方 然后临时关闭反馈,保持针尖高度及偏压不变, 测量隧穿电流随时间的变化(时域隧穿电流谱).粒 子扩散通过这个吸附位置时会导致隧穿电流发生变 化,从而被上方的针尖探测到.时域隧穿电流谱因此 含有扩散粒子在这个吸附位置的驻留时间信息.在 温度 T 下,假定零时刻扩散粒子处在给定位置,那 么在 t 时刻发现它没有跳走而仍然处在这个位置的 几率是^[9]:

$$P(t) = \exp(-\Gamma t)$$

其中 Γ 是在温度T下跳出这个吸附位置的跳跃频 率,即粒子在该吸附位置的平均驻留时间 Γ 的倒 数.由跳跃频率 Γ 与温度T的Arrhenius关系

$$\Gamma = \Gamma_0 \exp(-E_s/kT)$$

可获得扩散激活能 E_a 的数值,前系数 Γ_0 则包含扩散粒子振动频率信息. 而扩散系数 D 可由下列公式给出:

$$D = \alpha l^2 \Gamma$$

其中 α 为与晶格和扩散路径有关的常数 , l 为跳跃 长度 , Γ 为跳跃频率.

类似的方法曾被用于检测针尖电流激励下的表面 C₂H₂ 分子的转动及针尖激励下表面 Si 原子的位



图 1 用固定 STM 针尖进行粒子扩散运动测量原理图

移^[10,11],但用于检测无外界激励下单个粒子在表面 局域区间内的自发扩散运动尚属首次.

为了演示这种方法,我们选择研究单个 Cu 原 子在 Si(111)(7×7)层错半单元(F-HUC)内的扩 散运动.在这里由于表面重构的存在,Cu 原子跳出 这个半单元的激活能相对较高,从而被限制在这个 纳米尺寸的区域内运动.它的扩散运动会多次重复 地通过同一个吸附位置,因而非常有利于用 STM 针 尖进行定点的测量.

实验使用 Omicron 变温扫描隧道显微镜在超高 真空(~7×10⁻¹¹Torr)下完成的. 针尖是经 Ar 离子 清洁处理后的 W 针尖. Si(111)表面经过去气和 1500K 高温处理后获得了清洁的7×7 重构,然后在 室温下将约0.002 单层的 Cu 蒸到 Si(111)(7×7) 表面.在 STM 测量过程中,样品温度由低温块和电 热丝共同控制.为了保证统计精度,我们在每个温度 每个等价吸附位置上采集了约200 到700个跳跃事 件.为了减小 STM 针尖的影响,STM 的工作隧穿电 流保持在 50pA,隧穿电流 – 针尖高度(*I – Z*)关系 曲线表明,针尖离样品大约1nm.

图 2 是室温下 Si(111)(7×7)表面吸附少量 Cu 原子的 STM 图像. 在负偏压下, 硅顶戴原子表现 为亮点(最高),角洞最黑(最低). 有趣的是,当只有 一个单个的 Cu 原子吸附在硅表面的层错半单元 时 STM 图像表现为六个高亮点(比 Si 顶戴原子更 亮)形成一个高亮三角形. 先前这些三角形图案常 被认为是由 3 个或 6 个原子构成的团簇^[12,13]. 我们 的低温 STM 图像清楚地显示,当降温到 77K 时就 只有一个高亮点还留在 F-HUC. 另外两种贵金属元 素, Au 和 Ag 在硅表面的吸附也有同样的现象. 这 种图像随温度的变化是可逆的,表明室温下的 6 个 亮点是单个原子在 6 个不同吸附位高速跳跃引起 的. 这个结论之前曾由间接方法获得过^[14,15].

使用上面提到的新方法,我们定量地测量 200—320K 温度范围内 Cu 原子在 F-HUC 内的跳跃 频率,并且区分了从"角"和"边"Si 顶戴原子位置跳 出的两种情况¹⁾. 在图 3(a)中,我们给出了 208K 下 在角位置测出的典型的时域隧穿电流谱. 较低的电 流值是针尖与裸露硅表面的隧道电流. 而当 Cu 原 子运动到针尖下方的吸附位时,将引起比较高的电 流脉冲. 谱中随机分布的高电流脉冲显示 Cu 原子

第一性原理计算表明,Cu原子并非处在Si顶戴原子正上方,而是 有所偏离.本文仅讨论测量方法,吸附位置的详细计算结果在此 从略



图 2 Cu 吸附于 S(111)(7×7)层错半单元出现高亮 三角形的室温 STM 图像(插图为降温至77K的图像,高 亮三角形都转化为单一一个最亮点,所有图像均用 -2.0V和0.05nA的扫描条件获得,图中的圈和叉分别 代表 Cu 原子的角吸附位和边吸附位)

出现在相应的吸附位置的事件是完全随机的. 在图 3(b)中,我们画出了 Cu 原子在角吸附位的驻留数 目随时间衰减的统计直方图. 它很好地遵从指数衰 减规律. 拟合结果显示,在角位置的平均驻留时间是 261±50ms. 同样我们也获得了此温度下 Cu 原子在 边位置的平均驻留时间为 11.8±2.5ms. 由前所述, 时间常数的倒数等于跳出给定位置的跳跃频率 *Γ*.

在图 4 中,我们给出在边和角 Si 顶戴原子位置 的超出 4 个量级(10° Hz— 10^{4} Hz)的跳跃频率与温 度之间的 Arrhenius 关系图. 更慢速的扩散运动可以 用连续扫描图像的方法获得. 跳跃频率数据可以由 $\Gamma = \Gamma_0 \exp(-E_a/kT)$ 很好地拟合. 由此推导出的扩 散激活能在两个不同吸附位置分别是边为 $E_a =$ 0. 36 ±0.02eV,角为 $E_a = 0.40 \pm 0.02eV$. 前系数 Γ_0 = $10^{10.7 \pm 0.3}$ Hz. 当电压从 – 0.5V 增加到 – 1.0V 时, 测出跳跃频率基本不变,表明针尖影响很小. 只有当 电压超过 – 2.0V,在低温区域才会出现比较明显的 针尖影响.

在时域隧穿电流谱中,还包含有跳跃频率以外的信息.在图3中,Cu在角位置的占据时间占总时间的占空比为31.5%,在边位置的测量结果为3.2%.在这两个位置的总占据率为34.7%,与F-HUC的三次对称性相符(理想数值为33.3%).这表明针尖下方的扩散运动是完全随机的,没有受到针尖的影响.从两个位置的平均占据时间的比例上也可以估计出 Cu 原子在这两个位置的吸附能之差



图 3 (a)在角 Si 顶戴原子上方得到的随时间变化的扫描隧道谱(高的电流脉冲表明 Cu 原子运动到针尖下方的事件)(b)角位置的驻留事件数目随时间衰减统计 直方图(实线是指数衰减拟合曲线,实验数据在 208K 温度和 0.5V 扫描电压下获得)



图 4 Cu 原子在 200 到 320K 下跳跃频率与温度的 Arrhenius 关系图(圆点和方点分别代表在边和角吸附位 置的数据)

约 40—50meV,与前述扩散激活能之差的 40meV 相符.

这个方法与其他方法相比有以下几点优势 :第 一,不需要对仪器进行任何改动就可以测量相对快 速的扩散运动. 这里我们使用的是仪器原配的前置 放大器(100kHz), 就能测得较传统 STM 测量方法 快3-4个量级的跳跃频率.如果使用更加快速的前 置放大器 这个数值将会进一步提高. 第二,这个方 法可以在不同的吸附位置分别测量,正如前面 Cu 原子在 Si(111)(7×7)层错半单元中角吸附位和 边吸附位一样. 第三,由于高温下扩散运动很快,使 用这个方法可以减少测量需要的时间. 比如可以提 高以前使用连续扫描图像方法和原子跟踪方法测量 体系的温度 然后用本文介绍的方法就可在短时间 内获得需要的结果. 第四,在时域隧穿电流谱中,可 以得到扩散粒子在单个吸附位驻留时间占空比,由 此可以获得相关位置吸附能的一些信息,同时这也 是研究外场影响(例如针尖影响)的一个手段.

对于限制在纳米区域内的扩散运动,扩散粒子 会多次重复经过同一个吸附位置,而非常适合采用 这个方法进行检测.对于大范围平坦的表面上的扩 散运动,扩散粒子运动到固定针尖下方的几率较小, 采用这个方法进行测量会受到一定的限制.我们可 以利用在台阶附近的 Schwoebel 势垒效应,用少量 原子建立一个纳米尺寸的岛,从而应用我们的方法 来研究粒子受限于岛上的扩散运动.也可以通过原 子搬运的方法构建类似于"量子栅栏"的纳米结构 来实现限域.对于沿着一维路径的扩散运动,限制更 容易实现,只要在两端各设置一个扩散原子无法跨 越的势垒.

总之,我们提出并演示了一种新的可以测量快 速扩散运动的扫描隧道显微镜方法,这种方法将会 使人们在原子尺度下对快速扩散运动比如氢原子的 量子扩散运动获得更进一步的理解.我们利用这种

方法对 Si(111)(7×7)层错半原胞内不同吸附位 的 Cu 原子扩散的跳跃频率进行了定量的测量,表 明在角位置 Cu 原子的吸附能比边位置低40meV 左 右. 对贵金属原子在 Si(111)(7×7)表面的吸附体 系,我们还清楚地展示出室温下 STM 图像高亮三角 形是由单个金属原子的快速运动导致的,而不是 3 个或6个原子的团簇.

致谢 感谢杨宏伟博士和李宏年教授在数据分析方面所给予的帮助 感谢陈东敏教授参与我们的讨论.

参考文献

- [1] Gomer R. Rep. Prog. Phys. ,1990 ,53 :917
- [2] Tsong T T. Prog. Surf. Sci. , 2000 , 64 : 199
- [3] Ganz E , Theiss S K , Hwang I S et al. Phys. Rev. Lett. , 1992 , 68 :1567
- [4] Swartzentruber B S. Phys. Rev. Lett. , 1996 , 76 : 459
- [5] Schaub R, Wahlstrom E, Ronnau A et al. Science, 2003, 299:377
- [6] Renisch S, Schuster R, Wintterlin J et al. Phys. Rev. Lett., 1999, 82:3839
- [7] Lin T S , Gomer R. Surf. Sci. , 1991 , 255 :41
- [8] Wang K D , Zhang C , Loy M M T et al. Phys. Rev. Lett. , 2005 , 94 :036103
- [9] Barth J V. Surf. Sci. Rep. , 2000 , 40 : 75
- [10] Stipe B C , Rezaei M A , Ho W. Phys. Rev. Lett. , 1998 , 81 : 1263
- [11] Stipe B C , Rezaei M A , Ho W. Phys. Rev. Lett. ,1997 ,79 : 4397
- [12] Yasue T , Koshikawa T , Tanaka T *et al.* Surf. Sci. , 1993 , 287 :1025
- [13] Chizhov I , Lee G , Willis R F. Appl. Phys. A , 1998 , 66 : S1003
- [14] Hirayama H , Okamoto H , Takayanagi K. Phys. Rev. B , 1999 , 60 :14 260
- [15] Jarolimek T, Myslivecek J, Sobotik P et al. Surf. Sci. ,2001, 482:386

·读者和编者 ·

读者来信

编辑部:

贵刊 2005 年 4 期登载的吴大猷的回忆文章(续一)里,第 237 页左栏 15 至 20 行,说的是"胡宁先生……考取了清华大学 留美的资格,到美国去做扰流的研究……曾经来过台湾一次……". 我查了吴大猷先生的原文(《早期中国物理发展的回忆》, 台北联经出版事业公司 2001 87 页),这两句话前面讲的是胡宁先生,后面讲的是林家翘先生. 贵刊的文本做了不恰当的删 节,所以出了错,会使读者误以为说的是一个人.

事实上 林家翘先生和胡宁先生两人都先后去了美国留学 但胡宁做湍流(扰流)研究是出国前在西南联大跟随周培源先 生的时候 ,他后来没有再做这方面的工作 ,而且他一生也没有去过台湾.请予更正.

关 洪

2005年9月1日